

3. Кратко рассмотрим приложения задачи.

а. Спектроскопические приложения связаны с резонансами в коэффициенте поглощения слабого поля. При  $\Omega=0$  коэффициент поглощения на частоте слабого сигнала равен

$$\eta = \eta_0 \left[ 1 - \frac{2\alpha}{\alpha + 1} \frac{\alpha + 1}{(\alpha + 1)^2 + \Delta^2} - \frac{2\alpha}{\alpha} \operatorname{Re} \frac{f}{\beta(\alpha + \beta)} \right], \quad (3)$$

где  $\eta_0$  — ненасыщенный коэффициент поглощения. На фоне провала шириной  $(1 + \alpha)\Gamma$  появляется узкий провал, связанный с  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  и  $\gamma_0$ . Зависимость  $\beta$  от  $f$  характеризует уширение узкого провала полем. Природа этого провала связана с взаимодействием однонаправленных волн [4].

б. Найдем действие модулированного по частоте сигнала на усилитель, который состоит из резонатора Фабри—Перо с усиливющей средой ( $N$  отрицательно). Сигнал, частота которого промодулирована по гармоническому закону  $E(z, t) = 4E \cos(\omega t + \nu \sin \delta t) \cos kz$  при малых индексах модуляции  $\nu$  содержит три составляющих

$$E(z, t) = \{4E \cos \omega t + 4E' \cos [(\omega + \delta) t] - 4E' \cos [(\omega - \delta) t]\} \cos kz, \quad (4)$$

где  $E' = E\nu/2$ ;  $I(t)$  — интенсивность сигнала после усилителя пропорциональна  $dP/dtE$ , где  $dP/dt$  находится по формулам (2), а усреднение производится по оптической частоте

$$I(t) = I_0 \left[ 1 + \frac{\frac{\Omega}{\Gamma} \frac{E'}{E}}{(L \sin \delta t + M \cos \delta t)} \right],$$
$$L = 4\alpha \left\{ \frac{1}{(\alpha + 1)^2} - \frac{(\alpha + 1)^2 - \Delta^2}{[(\alpha + 1)^2 + \Delta^2]^2} \right\},$$
$$M = 4\alpha \Delta \frac{\alpha + 1}{[(\alpha + 1)^2 + \Delta^2]^2}.$$

Отсутствие амплитудной модуляции означает настройку на центр линии поглощения ( $\Omega=0$ ).

в. Введение в лазер ячейки с нелинейным поглощением приводит к устойчивости генерации в центре линии, так как коэффициент поглощения слабого сигнала (3) оказывается больше коэффициента поглощения сильного сигнала в центре линии. Такое рассмотрение устойчивости не всегда является достаточным, так как в принципе мы должны исследовать устойчивость на возможность нарастания любой суперпозиции типов колебаний резонатора [6]. Например, использование в качестве «затравочного» поля когерентной комбинации, пропорциональной  $E'$  в (4), приводит к исчезновению узкого провала в коэффициенте поглощения слабого поля. Коэффициент поглощения слабого поля при  $\Delta \ll 1$  оказывается равным коэффициенту поглощения сильного и вопрос об устойчивости остается открытым и требует дополнительных исследований.

Авторы благодарны В. П. Чеботаеву за обсуждение работы.

#### Литература

- [1] W. E. Lamb, Jr. Phys. Rev., 134, 1428, 1964.
- [2] Е. В. Бакланов, В. П. Чеботаев. ЖЭТФ, 62, 541, 1972.
- [3] Н. Г. Басов, О. Н. Компанец, В. С. Летохов, В. В. Никишин. ЖЭТФ, 59, 394, 1970; Е. В. Бакланов, В. П. Чеботаев. ЖЭТФ, 60, 552, 1971.
- [4] Е. В. Бакланов, В. П. Чеботаев. ЖЭТФ, 61, 922, 1971.
- [5] С. Г. Раутиан. Тр. ФИАН, 43, 3, 1968.
- [6] Р. H. Pantell. J. Appl. Phys., 35, 1404, 1964.

Поступило в Редакцию 27 августа 1973 г.

УДК 535.8

## РАСТР ИЗ КОДОВ БАРКЕРА ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА С РАСТРОВОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

В. П. Лебедев

Помимо факторов, влияющих на аппаратурную функцию классического спектрометра, аппаратная функция спектрометра с растровой селективной модуляцией [1-3] определяется двумерной автокорреляционной функцией растра и параметрами электрического фильтра, выделяющего переменную составляющую фототока детектора излучения.

Выбор растра с более высоким коэффициентом сжатия  $l$  [4] при минимальном уровне боковых максимумов аппаратной функции, с большей глубиной модуляции светового потока в центре автокорреляционного максимума влечет за собой повышение чувствительности растрового спектрометра.

Различные виды растров рассматривались в работах [2, 3, 5, 6]. Предлагается растр (рис. 1), составленный из кодов Баркера [4, 7]  $N=11, N=13$ . Растр образуют 24 столбца  $\delta \times \Delta$ , набранные из чередующихся черных и белых элементов. По признаку цвета нижних элементов набраны коды  $N=11$  и  $N=13$ . Коды  $N=11$  и  $N=13$  представлены соответственно девятипериодными и десятипериодными столбцами, чем достигается отсутствие взаимной корреляции между частями растра, образованными разноименными кодами. На рис. 2 представлен квадрант переменной составляющей автокорреляционной функции растра  $G(\eta, \xi)$  и аппаратная функция растрового спектрометра  $I(\eta)$ . Сечения  $G(\eta, \xi)$  вдоль осей задержек  $\eta$  и  $\xi$  существенно различны по структуре. Растр должен ориентироваться так, чтобы ось  $\eta$  совпадала с направлением дисперсии, а модулирующее сканирование растра осуществлялось вдоль оси  $\xi$ . При этом максимальная глубина модуляции светового потока, близкая к  $k=1$ , осуществляется в пределах главного максимума. Большая глубина модуляции обусловлена корреляцией в чередовании черных и белых элементов в столбцах. Форма сечений  $G(\eta, \xi)$  при фиксированной задержке  $\eta$  повторяет форму биений меандров с периодами  $\Delta/9$  и  $\Delta/10$ .

Вторичные автокорреляционные максимумы кодов  $N=11$  и  $N=13$  равны по величине и имеют противоположные знаки, благодаря чему первые пять максимумов имеют минимум биений при нулевых задержках. Шестой боковой максимум по мощности составляет  $1/13$  светового потока частиц растра, образованной кодом  $N=13$  или  $1/24$  часть полного светового потока, пропускаемого растром.

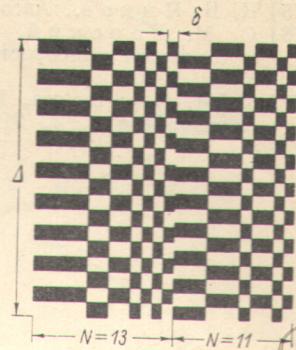


Рис. 1.

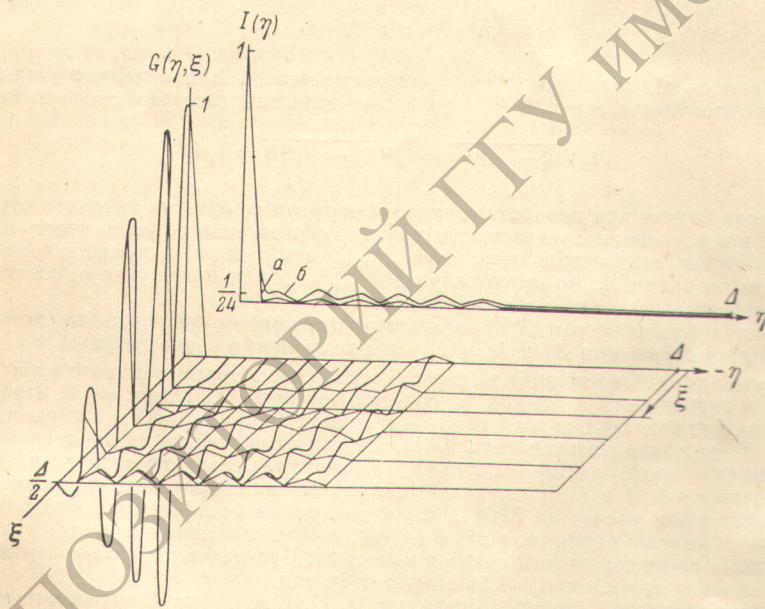


Рис. 2.

Можно подобрать величину максимальной задержки  $\xi$  при модулирующем сканировании растра так, что амплитуда боковых максимумов не будет превышать  $1/24$  центрального максимума.

Теоретическая (a) и экспериментальная (b) аппаратные функции растрового спектрометра  $I(\eta)$  приведены на рис. 2. Расчет произведен для широкополосного фильтра, исключающего только постоянную составляющую автокорреляционной функции растра.

Для рассмотренного растра  $l=24$ . По этому же принципу построены растры с  $l=36, 48$ . Для всех растров уровень боковых максимумов не превышает  $1/l$  центрального автокорреляционного пика.

## Литература

- [1] A. G i g a r d. Appl. Optics, 2, 79, 1963.
- [2] A. G i g a r d. Optica Acta, 7, 81, 1960.
- [3] K. I. Тарасов. Спектральные приборы. Изд. «Машиностроение», Л., 1968.
- [4] Ю. С. Лезин. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов. Изд. «Сов. радио», М., 1963.
- [5] К. Н. Чиков. Автореф. канд. дисс. Л., 1971.
- [6] С. М. Горский, В. А. Зверев, Г. К. Иванова. Матер. совещ. Комиссии приборостроения при Астрономическом Совете АН СССР, вып. 3, 67, 1970.
- [7] И. М. Иванова, Ю. Л. Кетков, Т. С. Ямпольская. Изв. вузов, радиофизика, 3, 911, 1960.

Поступило в Редакцию 10 сентября 1973 г.

УДК 535.824.31

## ОБ УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ

*И. Н. Шкляревский, Г. Зартов и Е. А. Лупашко*

Во многих схемах, включая лазерные установки, многослойные диэлектрические высокоотражающие зеркала располагаются под углом к падающему на них пучку света. При этом поступают двояким образом. 1. Зеркало *A*, оптические толщины соседних слоев которого

$$t_1 n_1 = t_2 n_2 = \lambda_0 / 4, \quad (1)$$

устанавливаются под заданным углом  $\varphi_0$  к пучку света. 2. Для заданного угла падения света  $\varphi_0$  изготавливается зеркало *B*, оптические толщины соседних слоев которого

$$t_1 \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \varphi} = t_2 \sqrt{n_2^2 - \sin^2 \varphi} = \lambda_0 / 4. \quad (2)$$

В первом случае при повороте зеркала *A* на угол  $\varphi_0$  область высокого отражения смещается в коротковолновую часть спектра. Это обстоятельство легко учесть при изготовлении зеркала, если необходимо, чтобы  $R_{\max}$  при данном  $\varphi_0$  соответствовало определенной длине волны  $\lambda_0$ . Во втором случае  $R_{\max}$  зеркала *B* при угле  $\varphi_0$  соответствует  $\lambda_0$ , для которой выполняется соотношение (2).

В работах Сухановского [1-3] рассчитаны и измерены спектральные зависимости коэффициентов отражения  $R_p$  и  $R_s$  для *p*- и *s*-компонент и разности фаз  $\Delta = \delta_p - \delta_s$  при  $\varphi_0 = 45^\circ$  зеркал типа *A*, состоящих из чередующихся слоев сернистого цинка и криолита. Приводится зависимость  $\Delta(\varphi)$  для  $\lambda_0$ , соответствующей  $R_{\max}$  при  $\varphi=0$ . В работе [4] для девятнадцатислойных зеркал ( $ZnS, MgF_2$ ) типа *B* при  $\varphi_0 = 30$  и  $45^\circ$  рассчитана и измерена спектральная зависимость  $\Delta(\lambda)$ . Цитируемые работы не дают возможности сделать вывод о преимуществе тех или других зеркал. Сравнение оптических характеристик зеркал типа *A* и *B* при наклонном падении света проведено в данной работе.

Мы выполнили расчет на ЭВМ М222 и измерение коэффициентов отражения и скачков фаз многослойников типа *A* и *B* ( $\varphi_0 = 30$  и  $45^\circ$ ), состоящих из семи и тринадцати чередующихся слоев сернистого цинка и криолита. При расчетах дисперсией показателей преломления  $n_1 = 2.3$  и  $n_2 = 1.35$  мы пренебрегли.

Методика нанесения зеркал *A* описана в [5, 6]. В зеркалах *B* оптические толщины соседних слоев при  $\varphi=0$  или  $\varphi \neq \varphi_0$  не равны друг другу. Так как контроль толщин осаждаемых слоев выгодно вести при нормальном падении монохроматического света на образец, мы поступили следующим образом. На контрольную подложку осаждалось зеркало, толщины слоев которого удовлетворяли (1). Подложки же изготавляемых зеркал *B* помещались на держателе, могущем перемещаться вверх и вниз с помощью микрометренного винта. Так как толщина данного осадка обратно пропорциональна квадрату расстояния испаритель—подложка, нетрудно рассчитать те расстояния, на которые нужно смещать подложку образца от контрольной подложки при испарении сернистого цинка и при испарении криолита, чтобы для  $\varphi = \varphi_0$  получить  $R_{\max}$  при  $\lambda = \lambda_0$ , по которой велся контроль толщин. Эти два положения держателя уточняются экспериментально, а затем фиксируются. Зеркала обоих типов изготавливались для  $\lambda_0 \sim 550$  нм.

Спектральные зависимости  $R_p$  и  $R_s$  при различных углах падения измерялись на спектрофотометре СФ-4 с специальной приставкой. Измерение дисперсии фазовых сдвигов  $\delta$  при  $\varphi=0$ ,  $\delta_p$  и  $\delta_s$  и  $\Delta = \delta_p - \delta_s$  при  $\varphi \neq 0$  проводилось интерферометрическим